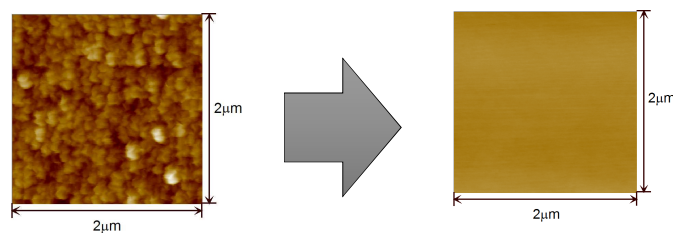
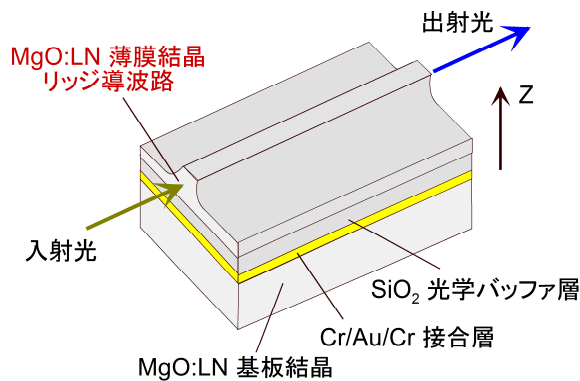
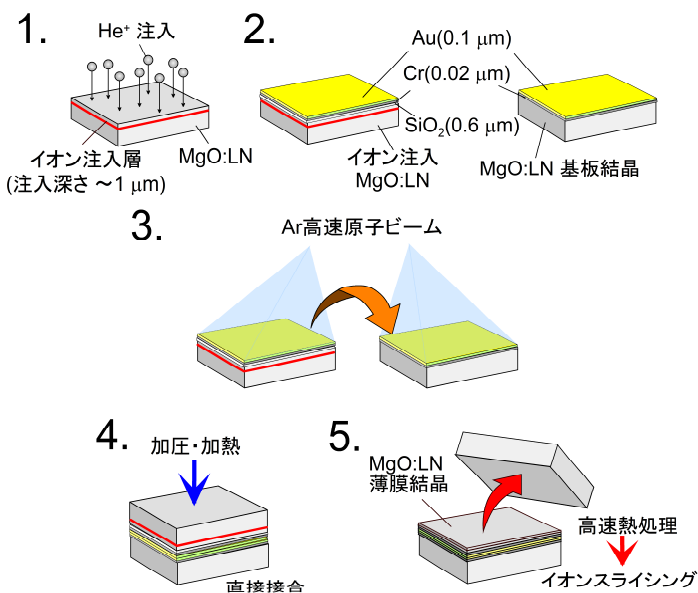


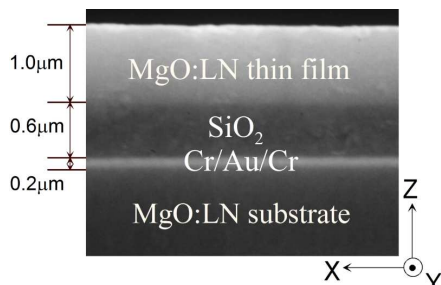
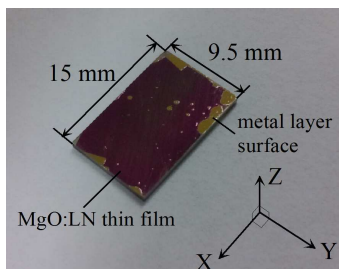
直接接合/イオンスライス/イオンエッチングによる MgO:LiNbO₃ 薄膜結晶リッジ導波路作製 と波長変換デバイスに関する研究

微細な薄膜結晶リッジ導波路を作製し、高効率非線形光学デバイスの実現を目指す

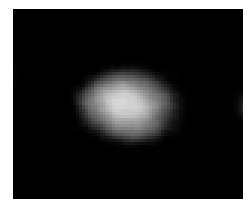
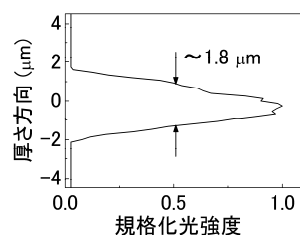
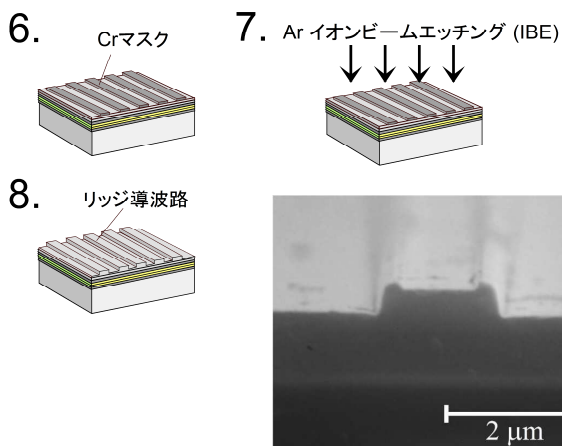
作製プロセス



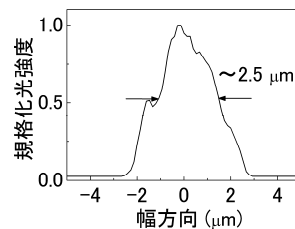
研磨処理により
イオンスライス直後の表面粗さを低減



1 μm^t 薄膜結晶作製に成功



TM モード



世界最小断面積の
MgO:LiNbO₃ リッジ導波路

強光閉じ込め